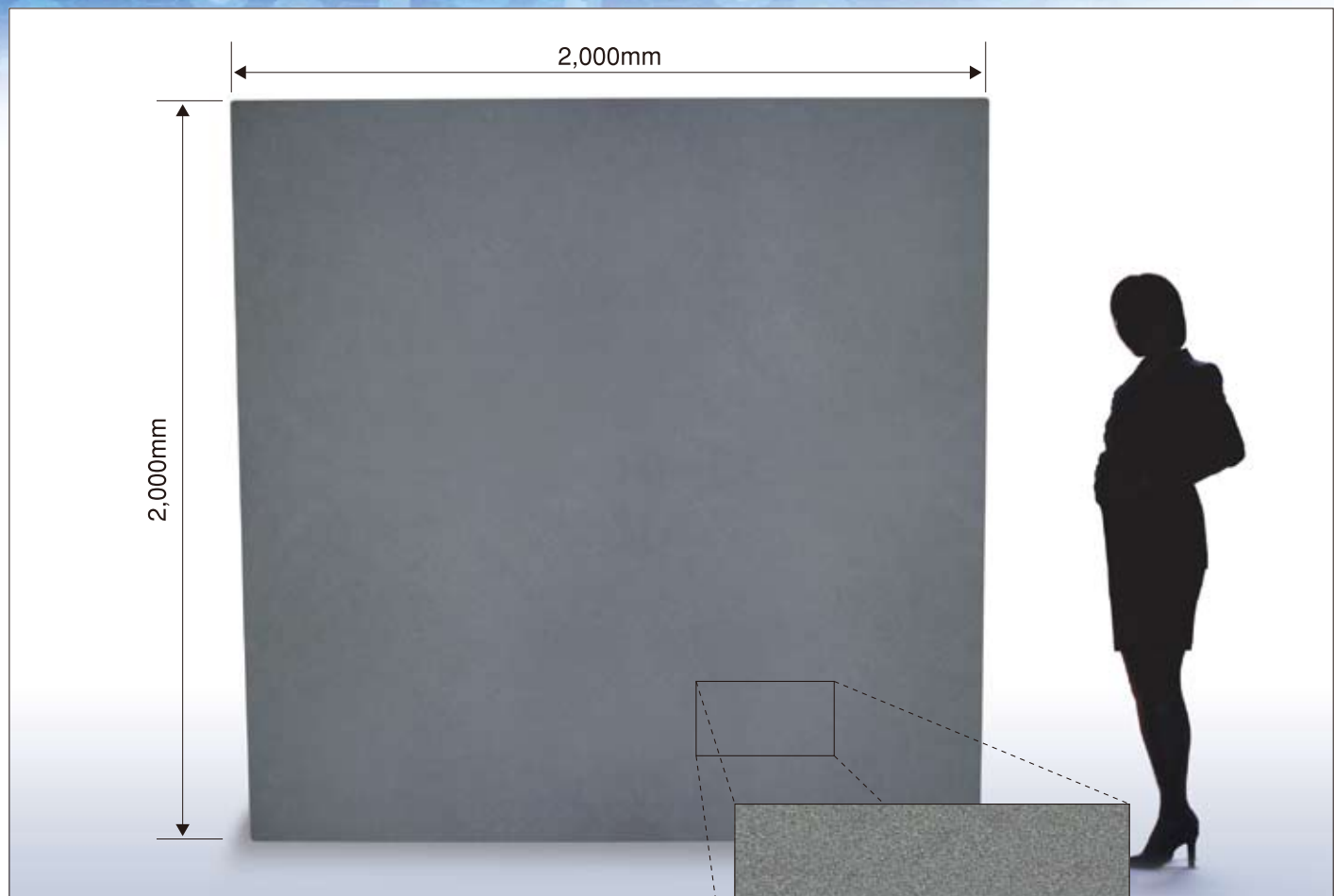


Porous Ceramics Vacuum Chuck

# 多孔質セラミックス真空チャック



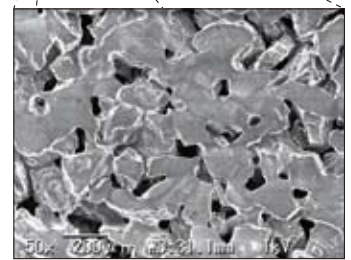
Nano-TEM



## その薄い素材はどの様にチャックしていますか？

- 半導体、液晶、プリント基板製造装置、印刷機のワーク保持用途に最適
- 均一な気孔径を有した多孔質セラミックスの採用と独自の真空排気方式により全面にわたり吸着力が均一にかかります
- 吸着部は被吸着物形状に合わせて製作可能  
さらに、オール多孔質セラミックス真空チャックへの対応も可能
- 吸着部寸法は最大□2.5mまで製作可能
- ウエット環境での使用が可能。加工機上でセルフカットが出来ますのでワーク固定治具としてお使い頂けます
- ラッピング、ポリッシングなどのスラリー環境での使用が可能

▲拡大写真



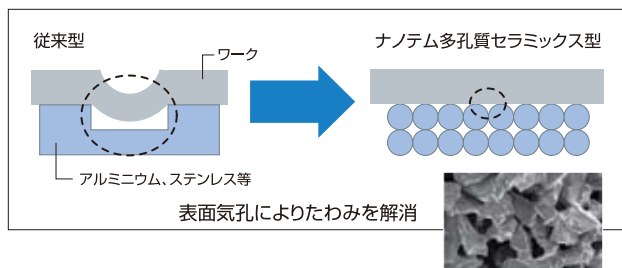
▲顕微鏡写真



ポラスチャック定盤 (G8, 2510x2210x320t)

新発想の吸着プレートというシーズ開発

従来型の真空チャックは、アルミニウムやステンレスの吸着面に溝、穴を設けワークを吸着します。しかし、これではワークが溝、穴にへこんでしまい、高精度の吸着は出来ません。そこで、サブミクロンから数百ミクロンまで気孔を調節できる多孔質セラミックスを開発。微細な気孔から空気を吸出し、セラミックス表面に研磨物を貼り付けて作業できる、真空チャックを実現しました。



■特徴

- ナノテム独自のセラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。
- 多孔質部の気孔率、気孔径を用途に応じて選定できます。※オプション
- 大型チャックにも対応いたします。最大2.5mまで対応 (石定盤代替)
- 基盤目状、もしくは同心円状に多孔質部を構成し、それぞれに独立した真空ポートを設けることが可能です。寸法形状の異なる多品種ワークは、有効にする真空ポートを選択することによって、チャックを複数個用意することなく一つのチャック本体で保持できます。※吸着部よりワークが大きくなり吸着しませんのでご注意ください。
- 吸着面が多孔質セラミックスなので、高精度なセルフカットが容易にできます。
- 磁性・非磁性体を問わず、吸着保持が可能です。
- 吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。
- 真空調圧弁により、吸着力の調節が可能です。
- ロータリージョイントを使用することにより、ワークを保持しながら回転させることが可能です。
- ウエット環境、スラリー環境での使用が可能です。
- 多孔質セラミックスの比重はアルミニウムより小さく、軽量化に最適です。  
※比重:1.6~1.8

お問い合わせはこちらまで



Nano-TEM

株式会社ナノテム

〒940-0012 新潟県長岡市下々条1丁目485番地  
TEL : 0258-22-6725 FAX : 0258-22-6726 E-mail : n-sales@nano-tem.com

www.nano-tem.com

■各種真空チャック



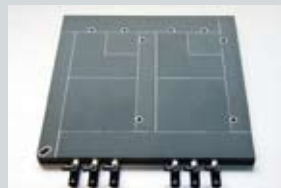
1. セラミックス台盤タイプ (□300)



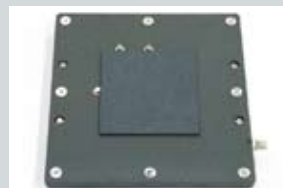
2. 額縁タイプ (690x570x50t)



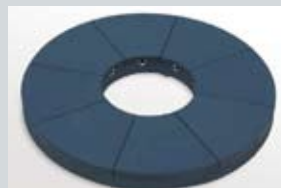
3. セラミックス台盤タイプ (φ100)



4. 領域分けタイプ

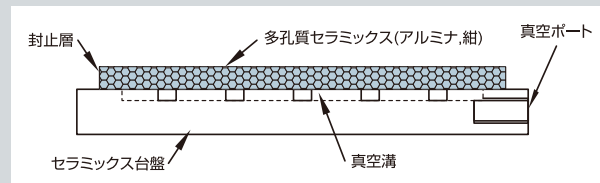


5. プッシュ例



6. 吸着回転円テーブル 9Bサイズ (φ640)

真空チャック断面図



■仕様

吸着部色	紺、白
吸着部寸法 (一体型)	最大/□2.5m 最大/○2.5m (オーバーサイズは別途相談可)
吸着部気孔率	標準40~50vol%
吸着部気孔径	標準30~100μm
台盤材質	セラミックス、石材、アルミニウム合金、 ステンレス合金 その他相談可
吸着部外周シール法	樹脂封止、無気孔セラミックス封止

※仕様はご相談により変更可能です。